BL40XU 高フラックス

本ビームラインはヘリカルアンジュレータを光源とし、 分光器を使用せずに2枚の全反射ミラーでビームを集光 することにより、準単色の高輝度X線ビームを使用でき るビームラインである。このビーム特性を活かして、回折、 散乱、XAFS、イメージングなど、多様な利用実験が行わ れている。本ビームラインには共同利用実験に供されて いる実験ハッチ1と、CREST研究プロジェクトにより建 設された実験ハッチ2がある。

1. 実験ハッチ1

実験ハッチ1では、2013年度から非結晶試料の 時分割X線回折、XPCS (X-ray Photon Correlation Spectroscopy)、1分子計測、マイクロビーム回折実験等 が行われている。今回は2014年度の年報に引き続き、高 速時分割測定に有用な高速CMOSビデオカメラの試験結 果について解説する。今回用いたのは高感度・高速機種 であるPhotron社製AX200である。このデモ機を借用し、 ビームライン備え付けの従来機種SA5と比較した。測定 はE=15 keV、カメラ長3.5 m、4インチイメージインテ ンシファイヤ、レンズ F=105 mm、サンプル=コラゲ ンの条件で行った。X線は1/100アッテネーター使用し、 回折像は両機種とも露光1/1000秒で10回露光したもの を加算した。

1-1 画像比較

CMOSカメラには大きな固定ノイズがあり、カメラ側 でこれを自動で差し引く操作(シェーディング)を行う のが通常の使用法である。

図1Aは従来どおりの測定で、SA5でシェーディングな しで記録、別に固定ノイズを同じフレーム数記録して平 均したものをそれぞれの記録フレームから引き算したも



図1 2機種で記録したコラゲンの回折像の比較

のである。図1BはSA5でシェーディング機能を使ったも の。強度0のピクセルが多数現れ、特に低カウント領域 での画像の劣化が著しい。このようにSA5ではシェーデ ィングの機能に問題がある。

AX200はシェーディングなしで記録しようとすると固 定ノイズだけで検出器が飽和してしまう。これはピクセ ルゲインが高く設定されているためだという。このため、 AX200ではシェーディングを使用した測定しかできない。

図1CはAX200でシェーディング機能を使ったもの。 SA5の画像に比べると輝度が格段に高い。強度0のピク セルは現れないようである。

1-2 強度プロファイル比較

図2は得られた10枚加算画像からコラゲンの回折強度 プロファイルを求めたものである。黒がSA5でシェーデ ィングなし。青がシェーディングありで特に低カウント 領域でカウント数がシェーディングありの場合よりも下 回り、ノイズも増加している。赤はAX200のシェーディ ング使用で、特にデータの劣化はみられない。ノーマラ イズすると黒のカーブと大体一致する。強度はSA5の場 合の3.0倍程度である。

1-3 まとめ

AX200はシェーディングなしの使い方ができない点が 懸念事項であったが、心配された画質の劣化は今回の測 定条件ではみられず、高感度のメリットを生かすことが できそうである。小型でとり回しが容易なこともメリッ トである。SA5に比較して3倍の感度はメーカーの公称 値より低く、これは前回のSA-Xの試験結果と同様だった。 しかしSA-Xと比較しても非常に高感度なので、弱い回



折像を高速撮影するうえでメリットがあると考えられる。 以上の試験結果から、正式にAX200をビームラインに導 入することになった。

2. 実験ハッチ2

実験ハッチ2では、ピンポイント構造計測装置を利用 した極微小単結晶構造解析や、次世代エンジンの燃料噴 射ノズルの開発のためのX線イメージング実験が行われ ている^[1, 2]。よりユーザーフレンドリーな極微小単結晶 構造解析システムを目指し、下記の装置をピンポイント 構造計測装置に導入した。

2-1 自動4象限スリットによるビームサイズ調整機構の 導入

極微小単結晶構造解析では、バックグラウンド低減の ためにスリットなどによってビームサイズを調整するこ とが必要である。従来、ビームサイズは手差しスリット によって決められたサイズにのみ変更が可能であり、そ の都度実験ハッチ内に入る必要もあったため、位置再現 性や欲しいビームサイズへの微調整ができないことが課 題となっていた。また、すでに導入している集光・平行 ビーム即時切替システムの切り替えにもビームサイズを 変更する必要があり自動化が必要であった。

そのため、Huber社製の2象限自動スリット2台を使い、 4象限スリットとして回折計に導入した(図3)。自動スリ ットの導入によりビーム位置の高い再現性や最小5ミク ロンまでの任意サイズのビームが作れるようになり、よ り低バックグラウンドの回折イメージが測定可能となっ ている。



図3 自動4象限スリット



図4 手動φ軸アダプタ(左図)と自動φ軸ステージ(右図)

2-2 自動φ軸ステージの導入

単結晶X線回折測定では、結晶方位を様々に変えなが らX線を照射する必要がある。微小単結晶測定を可能に するピンポイント構造計測装置では高い軸の回転精度を 要求するため、ω軸のみの1軸ゴニオメータが採用され ている。しかし、結晶方位を変えたいという要望もあり、 ×軸が45°固定の手動φ軸アダプタ(図4左)を導入して 複数の結晶方位での測定を実現していた。しかし、一方 位あたりの測定時間が短いこともあり、φ軸を手動で回 す作業がユーザーの負担になっていた。

自動 φ 軸ステージを実現するための課題として非常に 狭い試料周辺の空間に自動 φ 軸ステージをどのように設 置するかがあり、小型モータを利用したステージを開発 してピンポイント構造計測装置に導入した(図4右)。試 料マウント時に φ 軸とω軸をセンタリングすることで、 その後のセンタリングが不要になり、複数の φ 軸位置に おける測定を自動で行うことができるようになった。

また、副次的な効果としてΦ軸を連続的に回転させる ことによってガンドルフィ・カメラとして利用すること もでき、単結晶試料だけでなく、多結晶性試料1粒から でも均一な粉末回折パターンとして構造情報を得られる ようになった^[3]。

参考文献

- S. Moon, K. Komada, K. Sato, H. Yokohata, Y. Wada and N. Yasuda: *Experimental Thermal and Fluid Science* 68 (2015) 68.
- [2] K. Komada and S. Moon: Fuel, **181** (2016) 964.
- [3] N. Yasuda and S. Kimura: *Mater. Trans.*, **57** (2016) 1010.

利用研究促進部門 バイオ・ソフトマテリアルグループ 岩本 裕之・青山 光輝 ナノテクノロジー利用研究推進グループ 安田 伸広